

表面科学技術研究会 2025
半導体産業の現状と課題
— これからの日本を支える半導体技術 —

主催： 一般社団法人 表面技術協会 関西支部、公益社団法人 日本表面真空学会 関西支部

共催： 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所

協賛： 応用物理学会、応用物理学会関西支部、化学工学会、高分子学会、電気化学会、電気化学会関西支部、日本機械学会、日本材料科学会、日本太陽エネルギー学会、日本物理学会、日本油化学会、触媒学会、精密工学会、腐食防食学会、日本トライボロジー学会、日本金属学会、日本材料学会関西支部、日本化学会、日本分析化学会、日本セラミックス協会、光化学協会、光触媒工業会、大阪府技術協会、大阪工研協会、電気鍍金研究会（予定）

日時： 2025年1月31日（金）13:00～17:20

場所： 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター 大講堂（大阪市）
ならびに、ZOOMによるオンライン配信

定員： 会場80名、オンライン100名

参加費： 無料

内容： 近年、デジタル化の進展に伴い、半導体の重要性はますます高まっています。自動車やIoT、AIなど、あらゆる分野で半導体が不可欠となり、その需要は拡大の一途を辿っています。しかし、一方で、世界的な半導体不足や、先端技術開発競争の激化など、半導体産業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況を踏まえ、表面科学技術研究会 2025 では、「半導体産業の現状と課題」をテーマに、半導体産業の第一線で活躍されている研究者を招き、講演会を開催いたします。基調講演では、日本の半導体産業の現状と課題を総括し、依頼講演では、微細化、パッケージング技術、化合物半導体といった最先端の技術について深掘りします。半導体産業に関心のある方だけに限らず、多数のご参加をお待ちしております。

講演プログラム（仮）：

開会の挨拶 本多 信一（日本表面真空学会 関西支部 支部長）

1. [依頼講演 1] 産業の川上「結晶」が拓くグリーン・デジタル社会

森 勇介 先生（大阪大学）

2. [依頼講演 2] 先端半導体デバイス技術の現状と展望

小林 正治 先生（東京大学）

3. [依頼講演 3] チップレット集積技術の開発動向

栗田 洋一郎 先生（東京科学大学）

4. [基調講演(オンライン)] 本格的実用化を迎えた SiC パワーデバイスの現状と課題

木本 恒暢 先生（京都大学）

閉会の挨拶

藤田 直幸（表面技術協会 関西支部 支部長）

問い合わせ先： 公益社団法人日本表面真空学会 関西支部 表面科学技術研究会担当 平出雅人

(株)島津製作所 分析計測事業部 Solutions COE

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1, Tel/Fax: 075-823-1794/075-823-9326

E-mail: hirade@shimadzu.co.jp

申し込み締切り： 2025年1月24日（金）

申し込み方法： https://www.jvss.jp/chapter/kansai/hyoumengi_jutsu2025/（仮）
のフォームからオンラインで申込みください。

会場案内： 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター

〒536-8553 大阪市城東区森之宮 1-6-50（アクセスマップ www.omtri.or.jp/map/）

JR大阪環状線（北口）またはOsaka Metro 中央線・長堀鶴見緑地線森ノ宮駅（4番出口）下車。中央大通を東に約350m（徒歩約5分）、「森ノ宮公団住宅前」を左折し北に約350m（徒歩約5分）。